(19) 日本国特許庁 (JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60—17417

⑤Int. Cl.⁴ G 02 B 21/18 21/36 識別記号

庁内整理番号 7370-2H 7370-2H **④公開** 昭和60年(1985)1月29日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

9光学装置

願 昭58—125662

②出

②特

願 昭58(1983)7月11日

⑫発 明 者 小林亨

東京都板橋区蓮沼町75番1号東

京光学機械株式会社内

⑫発 明 者 観海雅允

東京都板橋区蓮沼町75番1号東京光学機械株式会社内

⑪出 願 人 東京光学機械株式会社

東京都板橋区蓮沼町75番1号

個代 理 人 弁理士 中村稔

外4名

明細

1. 発明の名称 光 学 装 置

2. 特許請求の範囲

/) 異なる 2 つの領域の物点を空中像として同時 に結像する単眼の対物光学系と;

該対物光学系の射出光東を第1の光路と第2 の光路との2光路を伝搬するように分割する光 東分割手段と;

該第1と第2の光路はそれぞれの光軸の一部 を互いに同軸的に対向する配置をもち;

前記対物光学系は、該第 / の光路による第 / 空中像と、該第 2 の光路による第 2 空中像とのそれぞれを、その方向を互いに光軸を軸として所定角度相対的に回転した関係で、かつ前記同軸的配置にある部分光路の延長上で互いに合致するように結像し;

該結像位置には、前記部分光路の光軸と垂直な稜線をもち、かつ該部分光路の光軸と互いに 反対方向に傾設された2つの反射面を有する髭 根型反射部材と; 該屋根型反射部材により偏向された第/光路と第2光路による前記第/及び第2空中像を観察するための観察光学系とから構成され、前記屋根型反射部材と、前記第/及び第2光路を前記はなり、前記第/空中像と第2空中像とする光学装置。

2) 前記回転角は180°であることを特徴とする特許諸水の範囲第2項記谳の光学装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は相互の間隔を比較的大きくして配置した微小の2物体の像を同一視野内で近接させて同時に観察するための光学装置に関する。

このように微小な比較的距離の離れた 2 物体を同一視野内で近接させて観察い。例えば、なってのでで、例えばなり野で多い。例えばなる。例えばなから、のないので、のが、をないない。のでは、のでは、のでは、ないは、ないない。のでは、ないないでは、ないないでは、ないないでは、ないないでは、ないないでは、ないないでは、ないのでは、ないいのでは、ないでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないで

本発明は係る要求を満たすために比較的大きな間隔にある異なる 2 領域上の 2 つの物点を近接させて同一視野内で観察でき、さらにはこれら 2 物点の位置出し調整用にも利用できる光学装置を提供することにある。

以下本発明の実施例を図をもとに説明する。

明レンズ系 3 1 2 から成る透過照明系 3 1 と、光源 3 2 1、照明レンズ 3 2 2、対物レンズ 3 3 0 及びハーフミラー 3 2 3 とから成る 落射照明系 3 1 と、光クル 3 3 2、リレーレンズ 3 3 3 及び T V カメラ 3 3 4 とから成る 観察 光学系 3 3 と、上述の正面観察系と同様のカメラコントローラ 3 4 1、 即定制御部 3 4 2 及び C R T 表示装示 3 4 3 とからなる電装部 3 4 とから構成されている。

第2図は正面観察系の観察光学系22の像間隔変換部221の第1の実施例を示す光学配置図である。この像間隔変換部221は対物レンズ 220からの光束を2光束に分別するためのピームスプリッター50と、第1の光路51を形成するための2枚の反射鏡52,53と、第2光路を形成する3枚の反射鏡55,56及び57とから構成され、これら2光路はその光路長が互いに等しい長さをもつよりに配置されている。

対物レンズ 2 2 0 の物側視界は、第 3 図に示すように、それ自身は小さいが、互いの配置間隔は

第/図は本発明の光学装置の光学配置を示す図で、被観察物体10を載置するための職物台11 と、被観察物体10の正面を観察するための正面 観察系20と、被観察物体10の側面を観察する ための側面観察系30とに大別される。

正面観察系 2 0 は、照明光源 2 1 1、コンデンサーレン 2 1 2、ハーフミラー 2 1 3 及び対物レン 2 2 0 から構成される照明光学系 2 1 と、別物レン 2 2 0 から構成で換部 2 2 1、個向プリズム 2 2 2、リレーレン 2 2 2 3、及び T V カメラ 2 2 4 から成る観察光学系 2 2 と、T V カメラ 2 2 4 から成る観察光学系 2 2 と、T V カノラー 2 3 0、カメラコントローラから送り和アーラー 2 3 0、カメラコントローラから送り和アー 3 0、カメラコントローラがら送り和アー 3 0、カメラコントローラがら送り和アー 3 0、カメラコントローラがら送り和アー 3 0、カメラコントローラがおりにでは観察物をモニターする C R T 表示装置し、物体 1 0 の 2 点間の位置出しや精度チェック時に被観察物をモニターする C R T 表示装置 2 3 2 とから成る電装部 2 3 とにより構成されている。

また、側面観察系30は、照明光源311と照

- 比較的大きい被観察物体である2つの小物体60, 6 1 を同時に取り込める広さをもつている。対物 レンズ220は、第4図に示すように小物体60 の第 / 光路に係る像 6 0′a と第 2 光路に係る像 60′bの2つの像を作る。同僚に対物レンズ 220は小物体 61の第1光路に係る像 61'aと 第1光路に係る像61bの1つの像を作る。ここ で、第1光路と第2光路は同一の光路長を有して いるので、像 6 0'a , 6 0'b , 6 1'a , 6 1'b は 同一平面上に形成され、かつビームスプリッター の半透過面50aの光束反射光束と反射鏡55の 光東反射光東が対物光軸を軸として/80°と回 転された関係にあるため、像 6 0' a と像 6 1' b と は一致し、同様に係60′bと61′aとは一致する ようにそれぞれ対物レンズ220により結像され る。

この第 / 光路 5 1 と第 2 光路 5 4 に垂直を結像 面内に稜線 5 8 c が位置するように配慮された 2 つの反射面 5 8 a , 5 8 b をもつ可動反射部材 5 8 が配置されている。この可動反射部材 5 8 は 第4図に示すように、その稜線58°が上記結像面内で、かつリレーレンズ223の光軸に垂直に維持されつつ58′,58″に示すような任意の位置に平行移動できるようになつている。この面反射部材58の平行移動により、その反射面 58 a,58 bが反射しリレーレンズ223に向けて入射させる対物レンスの結像像面の面積が変化する。そして、第4図に示すように、小物体像60′bと61′aの間隔が変化することになり、TVカメラ224は第5図に示すように小物体像60′,61′を近接させて同時に受像することができるようになる。

なお、本実施例においては可動反射部材58の 稜線に接しリレーレンズ223の光軸に垂直にレ チクル板59が配置されており、このレチクル板 59には第5図に示すような2つの交点をもつダ フル十字線59aが形成されている。

比較的大きさ間隔をもつこれら物点の位置出しをするに際し、この間隔を任意のあるいは所望の像間隔として得ることができるため、位置出し作業が極めて容易にかつ非常に正確にできる利点がある。

位置出しされるべき基準位置を示した基準スケール板(図示せず)を載憶する。この基準スケール板の像を観察光学系で第6図(A)で示すように受像する。次に、この基準スケール板のスケール線で一致させる。まず、像間隔変換部221の可動反射部材58を移動させ、第6図(B)のように両者を一致させる。この操作により基準スケール線の情報はレチクル板のダブル十字線に写されたことになる。

次に、戦物台10上の基準スケール板59を取り除き、小物体60、61を観儺する。その観察像例が第6図(C)である。そして小物体像60′、61′のそれぞれの所定部分位懺をレチクル59のダフル十字線59a及びその交点に合わせうるようにすることにより所定の位儼及び間隔配置し、これら位置決めした小物体60、61を基体に組付けることができる。

このように、本実施例によれば、小物体あるいは物品そのものは大きくとも基準となる部分が極めて小さな領域である2つの物品であつて、かつ

射面 8 1 b の反射する光東は、対物レンズ 2 2 0 の射出光東のほとんどの部分をそれぞれカバーできるため前述の第 / 実施例に比較して光量を大きくして明るい観察像を得ることができる。

第1反射面81 a で反射された光東は、第7四 に示すように、第1台形反射プリズム82に入射 し、第1反射面821で反射され、次いで第2反 射面822で反射され、六角形反射部材80の上 側 第 1 反 射 面 8 3 9 で 反 射 さ れ て レ チ ク ル 板 5 9 上に結像する。同様に、下側第2反射面81bで 反射された光東は第2台形反射プリズム84に入 射しその第 / 反射面 8 4 1 及び第 2 反射面 8 4 2 で順次反射されたのち六角形反射部材80の上側 第 2 反射面 8 3 b で反射され、レチクル板 5 9 上 に結像される。そして、第1及び第2台形反射プ リズム82,84を、第8図に示すように、六角 形皮射部材の長手方向に沿つて矢印の方向に移動 させることにより、光束のレチクル59上の結像 位置を移動させることができ、これにより小物体 60,61の像間隔を変化させることができる。

本実施例においては、レチクル板及び六角形反射 部材は移動しないので、像間隔の変更にともなう 合焦状態の変化は生じない。

上記の第 / 及び第 2 実施例は横方向に並らんだ 2物点の観察間隔を変化させるものであつたが、 本発明はこれに限定させるものでなく、2物点が 直角配置や、ある基準点を中心に互いに所定の角 **度をなすよりに配置される場合も両物点を近接さ** せて観察する第3実施例を第9図をもとに以下に 説明する。例えば、互いに直角に配置されるべき 小物体60,61が図示しない戦物台に目測で略 直角に載置されているものとする。この2つの小 物体60,61の像を形成するための光束は、対 物レンズ220で集光射出されたのちビームスプ リデターミラー90によつて第1光路91と第2 光路92に2分割される。第1光路にはミラー 93がありこのミラー93で偏向された光束は後 述の像間隔変換部94に導かれる。一方、第2光 路92内には、イメージローテーター95が配置 されており、ピームスプリャターミラー90を透

射出するよう構成されている。イメージローテーター95からの射出光は第1光路92のミラー96,97で反射され、像間隔変換部94に入射する。この構成により、第1光路91を介して対対物レンズ220で結像される小物体60,61%は新1光路92を介して結像であり、61%は前述の寒60%、61%は前述の寒60%、61%は極される。 第10回は、上記の像間隔変換部94の構成の大寒路例を示す光学配置図であり、第1光路の大力、第1の機のであり、第1光路の大力を表しては、像61%に、像61%に、像60%に一致するように結像される。

過してきた光束を光軸回わりに90。回転させて

第 / O 図は、上記の像間隔変換部9 4 の構成の一実施例を示す光学配置図であり、第 / 光路の光東は第 / 平行四辺形プリズム 1 0 0 に入射され、その第 / 反射面 1 0 1 及び第 2 反射面 1 0 2 で反射され家形反射部材 1 0 3 に導かれる。この家形反射部材 1 0 3 は前述の第 2 実施例の六角形反射部材 8 0 の上半分を利用するもので、その第 / 反射面 1 0 4、第 2 反射面 1 0 5 及び稜線 1 0 6 の

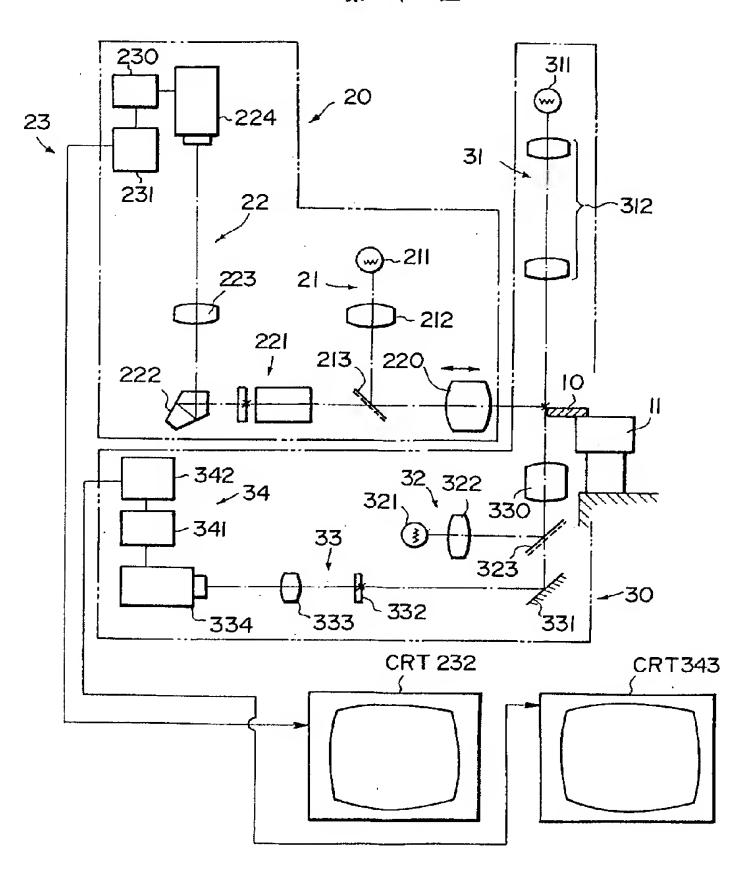
構成は、前述の六角形反射部材80と同様である。 平行四辺形プリズムを射出した光束は家形反射部 材103の第1反射面104で反射され、この稜 線に当接配置されたレチクル板59に像(60')を 結像する。一方、第2光録92の光東は第2平行 四辺形プリズム107に入射し、その第1反射面 108及び第2反射面109で反射され、射出さ れたのち家形反射部材103の第2反射面105 で反射され、レチクル板 5 9 に像 (61 11) を結像す る。第1及び第2平行四辺形プリズムを矢印 110,111の方向に移動させることにより像 (60′), (61 ″) の間隔を変化させることができる。 なむ、イメーシローテーター95の光軸に対す る回転角を変えることにより、小物体60,61. が互いに鋭角あるいは鈍角配備をとる場合でもそ れらの像 60′、61″ 等を同一視野内で近接観察す ることができる。

4 図面の簡単な説明

第/図は本発明に係る光学装置の実施例を示す 光学配置図、第2図は像間隔変換部の第/の実施 例を示す図、第3図は対物レンズの物側視界を模式的に示す図、第4図は可動反射部材の移動の像の関係を示す図、第5図は視察視野の一例を示す図、第6図(M)から(D)は視察手順を示す視察視野図、第7図は像間隔変換部の第2の実施例を示す光学配置図、第9図は年の第2実施例における像間隔変換部の一例を示す光学配置図である。

- 10 ……被 被 額 察 物 体、
- 20 …… 正面観察系、
- 30 …… 測面観察系、
- 5 0 …… ビームスプリーター、
- 53,57 ミラー、
- 5 8 …… 可動反射部材、
- 5 9 …… レチクル板、
- 80 …… 六角形反射部材、
- 82,84 台形反射プリズム。

第 | 図



第 2 図

